台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 113.06.19 文
檔號: 113319

財團法人工業技術研究院　函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：黃盈禎
電話：03-5913935
E-mail：ycmhuang@itri.org.tw

1130012419002

241402 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 4 號 10 樓

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會(TMBIA)
發文日期：中華民國 113 年 06 月 18 日
發文字號：工研轉字第 1130012419 號
速別：普通件
密等：無
附件：無

主旨：本院擬舉辦「113 年度工研院量測技術發展中心臭氧消毒、太陽能元件電性、氣壓式量測與光通量量測等相關研發成果讓與案」公開招標活動，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「113 年度工研院量測技術發展中心臭氧消毒、太陽能元件電性、氣壓式量測與光通量量測等相關研發成果讓與案」（12 案 28 件專利）之公開招標活動（讓與標的詳如附件）。

二、「讓與標的」共分為四個類別：

（一）臭氧消毒與醫療應用：7 案 17 件；

（二）太陽能元件電性與能源應用：1 案 3 件；

（三）氣壓式與醫療應用：3 案 7 件；

（四）光通量量測與照明應用：1 案 1 件。

三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：

（一）本案截標日為民國（下同）113 年 7 月 3 日，開標包含初審（113 年 7 月 10 日）及複審（決標日為 113 年 7 月 17 日），投標廠商於通過初審後，始進入複審。會另行通知投標

廠商，請廠商依通知時間進行複審。

（二）有關本活動詳細資訊及標的，請上網搜尋：「工業技術研究院-公告-專利移轉及研發成果-113 年度工研院量測技術發展中心臭氧消毒、太陽能元件電性、氣壓式量測與光通量量測等相關研發成果讓與案」或上官網(www.itri.org.tw)查詢本案資訊。

（三）公開說明會資訊：

1、舉辦時間：113 年 6 月 25 日 14 時舉辦。

2、舉辦地點：採取線上方式辦理。

3、報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 113 年 6 月 24 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「113 年度工研院量測技術發展中心臭氧消毒、太陽能元件電性、氣壓式量測與光通量量測等相關研發成果讓與案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 113 年 6 月 24 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 黃小姐

電話：（03）591-3935

傳真：（03）582-0466

電子信箱：ycmhuang@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會(TMBIA)

院長 劉文雄

依本院權責劃分規定授權業務主管決行

113/5/24 第 2 版

113 年度工研院量測技術發展中心
臭氧消毒、太陽能元件電性、氣壓式量測與光通量量測等相關研發成果讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含專利 12 案 28 件（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）113 年 6 月 25 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 113 年 6 月 24 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「113 年度工研院量測技術發展中心臭氧消毒、太陽能元件電性、氣壓式量測與光通量量測等相關研發成果讓與案-公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。)予工研院技術移轉與法律中心(以下簡稱「技轉法律中心」)聯絡人(請詳十二、聯絡方式)進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 113 年 6 月 24 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 113 年 7 月 3 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

（一）本讓與案採通訊或親送方式投標。

投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1.（密封）價格封。

2.押標金。

3.公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司

登記/變更資料或公司設立登記表影本)。

4.近兩年財報資料。

5.公司基本資料暨運用規劃說明表。

6.商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)

(前述全部資料文件等，以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「113 年度工研院量測技術發展中心臭氧消毒、太陽能元件電性、氣壓式量測與光通量量測等相關研發成果讓與案投標」，於截標日 113 年 7 月 3 日 17 時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 黃小姐收。

(二)廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表及商業營運計畫書中詳細敘明，並於公司基本資料暨運用規劃表敘明境外實施金額。

(三)商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1.公司背景／關係企業／合作夥伴簡介(20%)

2.公司財務狀況(20%)

3.公司營運／研發能力(20%)

4.「讓與標的」運用規劃(30%)

5.國內產業效益(10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四)投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。(「讓與標的」以同一發明為一案。)

(五)本讓與案不得共同投標或重複投標。

(六)投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七)投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

(一)押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)。

(二)押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。

（三）得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

（一）投標時間截止後之投標。

（二）開標前業已公告停止本讓與案交易程序。

（三）投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。

（四）投標單附加任何成交條件者。

（五）「投標文件」之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。

（六）「投標文件」有所缺漏者。但押標金不足或商業營運計畫書份數不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於複審前未能補足者，其投標為無效。

（七）投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。

（八）投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方式：

（一）分為初審（113 年 7 月 10 日）及複審（113 年 7 月 17 日），投標廠商於通過初審後，始能進入複審。工研院會另行通知通過初審之投標廠商依通知時間進行複審。

（二）得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。

（三）初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、近兩年財報資料、商業營運計畫書、價格封等進行形式審查及確認。

（四）投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會議就商業營運計畫書、價格等進行複審，投標廠商於複審時應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。

（五）投標廠商若有境外實施需求，除應依「五、投標方法」第（二）點敘明外，並應於複審時報告說明。

（六）複審時，工研院開標審議委員會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商有一次優先加價機會，若此優先加價仍無超過底價，之後則由超過及格分之所有投標廠商同時議價，議價次數以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上超過及格分之投標廠商之投標金額超過底價且相同，得提供該投標廠商議價機會，並以高價者得標。議價次數以三次為限，經三次議價後之投標金額仍相同者，

由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)

(七) 開標時將請律師到場監標。

(八) 開標結果依政府法令相關規定，須向主管機關呈報者，則於主管機關同意後始生效力。

(九) 工研院將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。

(十) 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院開標審議委員會審查通過，方得簽約。

九、契約事項：

(一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。「讓與契約書」原則上應具備「九、契約事項」所載之條件；但基於產業運用效益等考量，雙方得於「授權契約」中另議合法合規之條件。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。

(二) 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院開標審議委員會審查通過，方得簽約。

(三) 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院開標審議委員會審查通過，方得簽約。

(四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定(包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定)。前述法令變動時，亦同。

(五) 得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。

(六) 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。

(七) 反授權約定：得標廠商同意工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人(以下簡稱「後手」)時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」

再為專屬授權或讓與時亦同。

（八）得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，容忍於「讓與契約書」生效前：

1.工研院已與第三人簽訂之授權契約，但工研院仍得保有向該第三人收取授權費用之權利；

2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及

3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。

（九）得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

（十）「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

（十一）「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意配合工研院為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院核准及同意後始得為之：

1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；

2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區

域外製造或使用者；

3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

（十二）得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與「後手」之讓與契約，否則即視為得標廠商已將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」，工研院得依前述約定行使相關權利。

（十三）得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十五項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

（十四）基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

（十五）得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

（十六）得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標

廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 黃小姐

電話：（03）591-7759，傳真：（03）582-0466。

電子信箱：ycmhuang@itri.org.tw。

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

附件一：讓與標的簡介

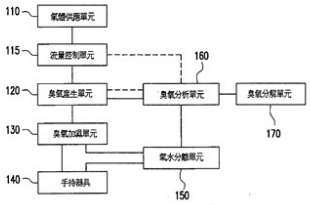
讓與標的說明1-2

專利介紹

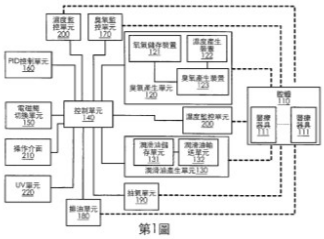
1. 臭氧消毒與醫療應用 7案17件		
P07990005	齲齒治療裝置	102/04/11
P07000011	氣體感測裝置及其校正方法	104/04/21
P07000013	臭氧產生裝置及控制放電模塊產生臭氧的方法	103/05/11
P07000014	夾置試片進行測試的轉盤裝置	103/10/01
P07010003	醫療器具的清潔消毒系統與方法	105/10/01
P07010008	臭氧消毒乾燥裝置與其方法	104/09/21
P07010009	臭氧消毒用手持裝置、方法、罩蓋、臭氧濃度感測模組及方法	106/03/11

可協助廠商布局醫療市場

P07990005齲齒治療裝置

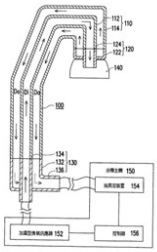


P07010003醫療器具清潔消毒系統

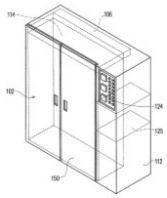


第1圖

P07010009臭氧消毒用手持裝置



P07010008臭氧消毒乾燥裝置



工業技術研究院機密資料 禁止複製、轉載、外流 ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

讓與標的說明2-2

專利介紹

2. 太陽能元件電性與能源應用 1案3件		
P07980033	太陽能電池之量測系統和太陽光模擬器	102/06/01

光源產生裝置由不同波長之發光二極體所組成，其發光頻譜符合一預定規範。

量測裝置量測待測物受光源照射後之電氣特性(如:電流/電壓)。

可協助廠商布局太陽光電市場

P07980033太陽能電池之量測系統和太陽光模擬器

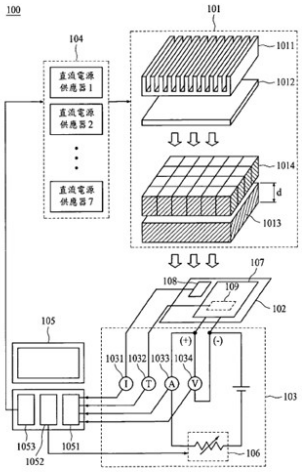


圖 1

工業技術研究院機密資料 禁止複製、轉載、外流 ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

附件二：讓與專利清單

（一）臭氧消毒與醫療應用：7 案 17 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	專利種類	授權記錄
1	1	P07990005TW	齲齒治療裝置	中華民國	獲證	TWI392482	20130411	20300718	工研院	工研院	發明	
2	2	P07010009TWD1	臭氧消毒用手持裝置、方法、罩蓋、臭氧濃度感測模組及方法	中華民國	獲證	TWI613999	20180211	20330107	工研院	工研院	發明	
	3	P07010009TWC1	臭氧消毒用手持裝置、方法、罩蓋、臭氧濃度感測模組及方法	中華民國	獲證	TWI573567	20170311	20330107	工研院	工研院	發明	
	4	P07010009CND1	臭氧濃度感測方法及臭氧消毒方法	中國大陸	獲證	CN106093122	20190607	20330313	工研院	工研院	發明	V
	5	P07010009CNC1	臭氧消毒用手持裝置、罩蓋、臭氧濃度感測模塊及方法	中國大陸	獲證	CN103654988	20170412	20330313	工研院	工研院	發明	
3	6	P07010008TW	臭氧消毒乾燥裝置與其方法	中華民國	獲證	TWI500891	20150921	20320607	工研院	工研院	發明	V
4	7	P07010003TW	醫療器具的清潔消毒系統與方法	中華民國	獲證	TWI551306	20161001	20320528	工研院	工研院	發明	
	8	P07010003CN	醫療器具的清潔消毒系統與方法	中國大陸	獲證	CN103446606	20151118	20320802	工研院	工研院	發明	
5	9	P07000014TW	夾置試片進行測試的轉盤裝置	中華民國	獲證	TWI454683	20141001	20310912	工研院	工研院	發明	
	10	P07000014CN	夾置試片進行測試的轉盤裝置	中國大陸	獲證	CN102998247	20150304	20311008	工研院	工研院	發明	
6	11	P07000013TW	臭氧產生裝置及控制放電模	中華民國	獲證	TWI436820	20140511	20310901	工研院	工研院	發明	V

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	專利種類	授權記錄
			組產生臭氧的方法									
	12	P07000013CN	臭氧產生裝置及控制放電模塊產生臭氧的方法	中國大陸	獲證	CN102976274	20140903	20310928	工研院	工研院	發明	V
7	13	P07000011USA1	氣體感測裝置及其校正方法	美國	獲證	D669375	20121023	20261022	工研院	工研院	設計	
	14	P07000011TW	氣體感測裝置及其校正方法	中華民國	獲證	TWI481866	20150421	20311016	工研院	工研院	發明	
	15	P07000011KR	氣體感測裝置及其校正方法	韓國	獲證	30-0701282	20130709	20280708	工研院	工研院	設計	V
	16	P07000011GB	氣體感測裝置及其校正方法	英國	獲證	GB4022850	20120330	20361222	工研院	工研院	設計	
	17	P07000011CN	氣體感測裝置及其校正方法	中國大陸	獲證	CN102955017	20161012	20311222	工研院	工研院	發明	

（二）太陽能元件電性與能源應用：1 案 3 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	專利種類	授權記錄
8	18	P07980033US	太陽能電池之量測系統和太陽光模擬器	美國	獲證	US9431954	20160830	20330325	工研院	工研院	發明	V
	19	P07980033TW	太陽能電池之量測系統和太陽光模擬器	中華民國	獲證	TWI397708	20130601	20300405	工研院	工研院	發明	V
	20	P07980033CN	太陽能電池的量測系統和太陽光模擬器	中國大陸	獲證	CN102221669	20150610	20300414	工研院	工研院	發明	V

（三）氣壓式與醫療應用：3 案 7 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	專利種類	授權記錄
9	21	P07970039TW	可攜式氣墊裝置	中華民國	獲證	TWI391109	20130401	20290329	工研院	工研院	發明	
	22	P07970039DE	可攜式氣墊裝置	德國	獲證	DE102009022603	20110915	20290525	工研院	工研院	發明	
10	23	P07960041GB	氣囊式重量檢測裝置	英國	獲證	EP2081001	20141217	20280326	工研院	工研院	發明	
11	24	P07950028USD1	心肺壓縮裝置	美國	獲證	US9155678	20151013	20280620	工研院	工研院	發明	

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	專利種類	授權記錄
	25	P07950028US	心肺壓縮裝置	美國	獲證	US8337436	20121225	20310104	工研院	工研院	發明	
	26	P07950028TW	心肺壓縮裝置	中華民國	獲證	TWI360416	20120321	20261213	工研院	工研院	發明	
	27	P07950028CN	心肺壓縮裝置	中國大陸	獲證	CN101209226	20100915	20261226	工研院	工研院	發明	

（四）太陽能元件電性與能源應用：1 案 1 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	專利種類	授權記錄
12	28	P07990001TW	光通量量測裝置及其量測方法	中華民國	獲證	TWI414764	20131111	20300628	工研院	工研院	發明	V

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。